

EPD - OES 产品

模块化、客户定制化

应用场景

- 显示面板、太阳能硅片 / 电池片、晶圆等半导体制程中的终点检测，提高产品良率，降低生产成本。

特点和指标

- 波长范围：200~1100nm（根据客户配置）
- 光学分辨率：<1nm@25μm 狭缝（FWHM）
- 传感器：CCD/CMOS（根据客户配置）
- 工作温度：5~50℃
- 检测材料：电介质、硅类、半导体化合物、金属及其化合物等。
- 可根据客户需求更换狭缝、光栅、传感器、滤光片来配置所需的分辨率、波长范围、信噪比、杂散光等关键参数。



产品型号	XD X6000 光谱仪	XD X4000 光谱仪
通讯方式	USB	USB
积分时间	3.8ms - 10s	3.8ms - 10s
探测器（可定制）	CCD	CCD
分辨率	< 1.0nm@25μm slit	< 1.0nm@25μm slit
信噪比	450：1	250：1
狭缝宽度	10μm - 100μm	10μm - 100μm
波段范围（可定制）	200nm - 1100nm	220nm - 1050nm